

OIM-DC

| | | Entry | Basic | Advance |
|-----------------------|------------------------------------|-------|-------|---------|
| OIM-DC全般 | OIM-DCの概説/構成 | ○ | ○ | |
| | EBSDパターンの指数付について | | ○ | △ |
| | 結晶方位の算出に関する計算法について | | △ | ○ |
| | 結晶方位の算出について(3バンド法について) | ○ | ○ | △ |
| | CI値の意味について | ○ | ○ | |
| | Fit値の意味について | | ○ | |
| Phase Page について | Phase データのLoad について | ○ | ○ | |
| | Phase Parameters の見方 | ○ | △ | ○ |
| Hough Page について | Hough 変換の原理について | ○ | ○ | △ |
| | Hough 変換のパラメーターについて | ○ | ○ | △ |
| Index Page について | Solutions の見方 | ○ | ○ | △ |
| | HKLs の見方 | | △ | ○ |
| | Ranking Factor について | | | ○ |
| | Pseudosymmetry について | | | ○ |
| | バンドの追加/削除について | | △ | ○ |
| Interactive Page について | SEM像の取込/保存について | ○ | ○ | |
| | パターンの指数付け/保存(Record)について | ○ | ○ | |
| | Analysis 部分の見方について | | △ | ○ |
| Scan Page について | 測定領域の設定について | ○ | ○ | |
| | Combo Scan について | | | (○) |
| | パターンの記録につて | ○ | | ○ |
| | ChiScan について | | | ○ |
| Simulation Page について | Unit Cell/PF/IPF の表示について | ○ | ○ | ○ |
| | | | | |
| キャリブレーションについて | キャリブレーションの考え方について | ○ | ○ | |
| | SEMのWDにキャリブレーション値を合わせる | ○ | ○ | |
| | Si 単結晶でキャリブレーションを行う | | | ○ |
| | 一時的なキャリブレーションを行う | | | ○ |
| | | | | |
| | | | | |
| Setting Menu について | Preference の設定 | | | ○ |
| Superuser の設定 | Environment Setting (座標系/試料傾斜角の設定) | | | ○ |
| | | | | |
| その他の機能 | SEM 像の Brightness/Contrast の調整 | | | ○ |
| | 取込むSEMの解像度の設定について | | | ○ |
| | SEM像の傾斜補正について | | | ○ |
| | | | | |
| 検出器の調整 | Gain, Black, Exposure と照射電流の関係 | ○ | ○ | |
| | Binning パラメータとConvolution Mask の関係 | | | ○ |
| Background 処理について | Background処理の考え方 | ○ | ○ | |
| | Standard モードによるBackground 処理 | | ○ | |
| | Enhanced モードによるBackground処理(1) | ○ | ○ | ○ |
| | Enhanced モードによるBackground処理(2) | | | ○ |
| | | | | |
| | | | | |
| SEM の条件設定 | 加速電圧の効果 | ○ | ○ | △ |

| | | | | |
|----------------|------------------------|--|---|---|
| | 倍率と分解能の関係 | | ○ | △ |
| | 統計的データの意味 | | | ○ |
| | | | | |
| 透過EBSD法に関して | 透過EBSD法とは | | ○ | ○ |
| | 透過EBSD法における試料のセットについて | | ○ | ○ |
| | 試料厚さの効果について | | | ○ |
| | 透過電子線の処理について | | | ○ |
| | Hough変換パラメーターのチューニング | | | ○ |
| | | | | |
| マテリアルデータの作成に関し | 同一結晶系/類似データの編集による作成 | | | △ |
| | ICDD等データベースを利用したデータの作成 | | | △ |
| | 実際のパターンから結晶の対称性を推測 | | | △ |
| | 実際のパターンでのマッチングによる確認 | | | △ |
| | | | | |